

事業者名	三重県								
機器名	イオンミリング装置								
写真									
特徴・用途	本装置は、走査電子顕微鏡の観察試料を加工するもの。本装置により観察試料表面や塑性変形層、汚れ、酸化被膜等をイオンビームエッチングにより削り取り、材料本来の結晶組織や表面のめっき膜の状態、破断時の破面組織等を表出させる微細加工を行う。								
設置場所	三重県工業研究所								
利用状況	年月	稼働日数 (日)	依頼試験・ 依頼分析 (件)	技術指導 (件)	試験設備貸出・利用		受託研究・ 共同研究 (件)	その他 (件)	利用件数 計(件)
	平成29年10月	5	2	0	件数(件)	時間(時間)	0	1	3
	平成29年11月	11	5	0	0	0	0	1	6
	平成29年12月	12	6	0	0	0	0	0	6
	平成30年1月	7	1	1	0	0	0	1	3
	平成30年2月	11	1	3	0	0	0	0	4
	平成30年3月	12	5	0	1	2	0	1	7
	平成30年4月	10	4	0	0	0	0	2	6
	平成30年5月	10	4	2	0	0	0	2	8
	平成30年6月	12	4	0	0	0	0	4	8
	平成30年7月	12	4	0	0	0	0	4	8
	平成30年8月	11	6	0	0	0	0	0	6
	平成30年9月	7	3	0	0	0	0	1	4
	平成30年10月	10	2	0	0	0	0	8	10
	平成30年11月	9	3	0	0	0	0	6	9
	平成30年12月	10	5	2	0	0	0	2	9
	平成31年1月	12	1	1	3	17	3	3	11
	平成31年2月	11	4	0	0	0	0	4	8
	平成31年3月	11	2	0	0	0	0	9	11
利用者等の声	<p>・機器開放で利用頂いた企業様には、より高精度な観察が可能となり満足していただいた。 (半導体素子の断面観察において接合面の状態と元素分析ができた。)</p>								
補助事業概要 の広報資料	https://hojo.keirin-autorace.or.jp/shinsei/document/list/kikai/h29/pdf/29-036koho.pdf								